

國立彰化師範大學共同儀器中心

奈米科技中心電漿耦合式離子蝕刻機對外服務辦法

一、儀器名稱：

中文名稱：電漿耦合式離子蝕刻機(金屬)

英文名稱：Inductively Coupled Plasma Reactive Ion Etch (ICP-RIE)

二、儀器廠牌、型號：

晶研科技 NARC、hdp^{sq} Etcher

三、儀器設備重要規格：

1. Max. source power : 1.2 kW
2. Max. Bias power: 600 W
3. Substrate size: 8.3 cm radius wafer

四、放置地點：

進德校區藝薈館 B1：奈米科技中心

五、儀器相關人員：

儀器負責教授	洪連輝 教授	(04) 7232105 ext. 3324
儀器管理人	許登翔 同學	(04) 7232105 ext. 3340

六、機台使用辦法：

本機台之使用為委託操作方式。由本中心指派合格人員代為操作儀器。

七、服務時間：

1. 本系統服務以二小時為一時段，最少預約 1 時段，每週開放 4 時段受理委託操作申請，操作時段為週四及週五：下午 13:00~17:00，其餘時段僅供本中心設備維護、人員訓練或計畫執行之用。對外開放時段，若因設備維護或技術訓練等事宜，得暫停開放。
2. 詳細開放時間逕洽儀器管理人。

八、申請辦法與規定事項：

1. 申請服務最遲須於一周前提出，否則不予受理。
2. 取消預約最遲須於前 3 日提出，否則仍應按申請時段繳交費用。
3. 申請人下載並填妥「奈米核心設施委託操作申請表」後，自行與儀器管理人接洽委託操作事宜。儀器操作人得視需要，要求申請人在現場共同進行實驗。

九、其他相關規定及懲處：

1. 若於預約當日，無法如期到場，且未事先取消該預約時段，累計 2 次以上，本中心得暫停該預約者 1 個月的預約權。
2. 未經許可私自帶走本實驗室任何物品者，提報指導教授與實驗室負責人另議懲處。

十、收費標準：

項目	校內外學術單位	產業界
費用	2000 元/時	3000 元/時
備註	1.收費時間以實際時間收費。若第一時段不足一時段者，仍以一時段計費；第一時段過後，每 0.5 時段（一小時）作為收費單位。 2.核心設施成員不收費，校內老師與計畫合作老師使用費用對折優惠。	